



## 112 年度工研院材料與化工研究所

### 電容去離子技術暨專利非專屬授權案

- 一、主辦單位：財團法人工業技術研究院（以下簡稱「工研院」）
- 二、非專屬授權標的：專利 1 案 1 件及技術 1 件。詳細資訊請參「附件：授權標的清單」。
- 三、非專屬授權廠商資格：國內依中華民國法令組織登記成立且從事研發、設計、製造或銷售之公司法人。
- 四、公開說明會：
  - （一）舉辦時間：民國（下同）112 年 4 月 19 日。
  - （二）舉辦地點：線上公開說明會。
  - （三）報名須知：採電子郵件方式報名。有意報名者，請於 112 年 4 月 18 日 12 時整（含）前以電子郵件向本案聯絡人報名（主旨請註明「112 年度工研院材料與化工研究所電容去離子技術暨專利非專屬授權案：公開說明會報名」，並於內文中註明：公司名稱、公司電話、參與人數、姓名、職稱）。工研院「技轉法律中心」聯絡人將於 112 年 4 月 18 日 17 時整（含）前發送電子郵件回覆並告知公開說明會會議資訊。
- 五、聯絡人：

工研院技術移轉與法律中心 李小姐  
電話：03-5917759  
傳真：03-5820466  
電子信箱：lislee@itri.org.tw  
地址：31057 新竹縣竹東鎮中興路四段 195 號 51 館 110 室

**附件：授權標的清單****一、申請中及獲證專利清單**

| 案號 | 件編號         | 專利名稱          | 國家   | 狀態 | 申請案號      | 公告號       | 專利起期     | 專利迄期     | 委辦單位   |
|----|-------------|---------------|------|----|-----------|-----------|----------|----------|--------|
| 1  | P55000084TW | 低溫快速合成電極材料的方法 | 中華民國 | 獲證 | 100148539 | TWI434959 | 20140421 | 20311225 | 經濟部技術處 |

**【備註】**:本授權案所包含之專利範圍除專利清單明載外，包含上開專利之 EPC 申請案指定國別後所包含之各國專利。本院不擔保上述標的之尚在申請中之專利可獲證，或可依原始申請範圍獲證，或已獲證專利不會被撤銷、消滅或其範圍不會變更。

**二、技術清單**

| 項次 | 產出年度 | 技術名稱      | 技術特色  | 可應用範圍                | 科專計畫名稱           |
|----|------|-----------|---|----------------------|------------------|
| 1  | 111  | 電容去離子淨水技術 | 開發高耐用性電極製程技術及長效淨水模組商品化技術，完成電極漿料配方確立及最適極板選用，達到高強度、低阻抗電極之生產，並完成淨水模組設計、串並聯配置及最佳操作策略建立，達到長效型淨水模組開發。 | 家用/商業用淨水器、軟水機等淨水相關產業 | 電容去離子淨水技術商品化開發計畫 |